PHOTORECORDING MEDIUM

Publication number: JP10058828 **Publication date:** 1998-03-03

Inventor:

UMEHARA HIDEKI: TANIGUCHI YOSHITERU; MISAWA TSUTAYOSHI; SUGIMOTO KENICHI; NISHIMOTO TAIZO; TSUDA TAKESHI; TAKUMA HIROSUKE; HIROSE SUMIO

Applicant: MITSUI PETROCHEMICAL IND

Classification:

- international:

B41M5/26; C09B29/08; G11B7/24; G11B7/244; B41M5/26; C09B29/06; G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; C09B29/08;

G11B7/24

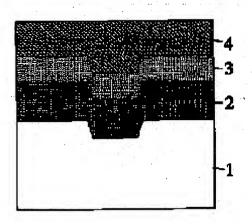
- european:

Application number: JP19960216181 19960816 Priority number(s): JP19960216181 19960816

Report a data error here

Abstract of JP10058828

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a DRAW (direct read after write) photorecording medium which is capable of recording data at high density and regenerating it under good condition with the help of a laser beam having a wavelength of 520-690mm. SOLUTION: In the photorecording medium with, at least, a recording layer 2 and a reflective layer 3 formed on a substrate 1, the recording layer 2 contains an azo compound or its metal complex which has an absorption maximum of wavelengths of 450-630nm as expressed by the formula. In addition, the recording layer 2 is capable of recording and regenerating data with a laser beam selected within the range of wavelengths of 520-690nm. In the formula, R1 and R2 are independently a hydrogen atom, a substituted or an unsubstituted alkyl group, a substituted or an unsubstituted aryl group, a substituted or an unsubstituted aralkyl group and a substituted or an unsubstituted alkenyl group; R3, R4, R5 and R6 and independently a hydrogen atom, halogen atom, a hydroxy group, a carboxyl group, a sulfone group a sulfonamide group, an amino group, a substituted or an unsubstituted aryl group, a substituted or an unsubstituted acyl, a substituted or an unsubstituted alkylcarboxyl group, a substituted or an unsubstituted aralkyl group, a substituted or an unsubstiuted alkylcarboxylamine group, a substituted or an unsubstituted alkylsulfonamino group, a substituted or an unsubstituted alkylamino group, a substituted or an unsubstituted alkylsulfone group and a substituted or an unsubstituted alkenyl group.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-58828

(43)公開日 平成10年(1998) 3月3日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B41M 5/26			B41M 5/26	Y
C 0 9 B 29/08			C 0 9 B 29/08	A
G11B 7/24	5 1 6	8721-5D	G 1 1 B 7/24	5 1 6

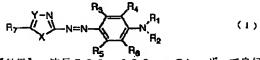
審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 31 頁)

(21)出願番号	特膜平8 -216181	(71) 出顧人	000003126
			三井東圧化学株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)8月16日		東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
		(72)発明者	梅原 英樹
			神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三井
			東圧化学株式会社内
		(72)発明者	谷口 義輝
		(1.2,32,742)	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
			東圧化学株式会社内
		(79) 路昭老	三沢 伝美
		(14)元初日	一八 以天 神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三井
			東圧化学株式会社内
			最終頁に続く
		1	双科貝に成っ

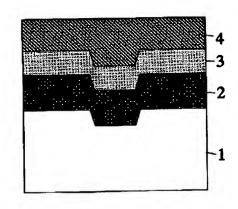
(54) 【発明の名称】 光記録媒体

(57)【要約】

【解決手段】 基板上に少なくとも記録層および反射層 を有する光記録媒体において、該記録層中に波長450 ~630nmに吸収極大を有する下記式(1)で示され るアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且つ、波長 520~690 nmの範囲から選択されるレーザー光に 対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記 録媒体。



【効果】 波長520~690 nmのレーザーで良好な 高密度記録記録及び再生が可能な追記型光記録媒体を提 供することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体において、該記録層中に波長450~630nmに吸収極大を有する下記式(1) 〔化1〕で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且

つ、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記録媒体。

【化1】

[式中、R₁ 及びR₂ は各々独立に水素原子、置換また は未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルケニル基を表し、R₃、R₄、R₅及びR₆は 各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、カ ルボキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表し(ここで、金属 錯体を形成する場合は、 R_3 及び R_5 のどちらか一方は ヒドロキシ基、カルボキシル基、アミノ基、置換または 未置換のアルキルカルボキシル基、置換または未置換の アルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換のアル キルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルア ミノ基であり、他方は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロ キシ基、カルボキシル基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表す。)、R, とR 4、R2とR6及びR1とR2は連結基を介して環を形 成してもよく、R7は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロ キシ基、カルボキシル基、スルホン基、スルホンアミド 基、アミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換ま たは未置換のアルコキシ基、置換または未置換のアリー ル基、置換または未置換のアシル基、置換または未置換 のアルキルカルボキシル基、置換または未置換のアラル キル基、置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ 基、置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基、置 換または未置換のアルキルアミノ基、置換または未置換 のアルキルスルホン基、置換または未置換のアルケニル 基、シアノ基、ニトロ基、メルカプト基、チオシアノ 基、クロロスルホン基、置換または未置換のアルキルチ オ基、置換または未置換のアルキルアゾメチン基、置換

または未置換のアルキルアミノスルホン基を表し、Xは、硫黄原子または $N-R_8$ を表し(ここで、 R_8 は水素原子、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアルケニル基を表す。)、Yは、X2、 案原子またはX3 に意味を表す。)。但し、X4 が硫黄原子の時、X4 に可じ意味を表す。)。但し、X5 が硫黄原子の時、X4 にある。]

【請求項2】 記録層中に含有する波長450~630 nmに吸収極大を有する化合物が、下記式(2) 〔化 2〕で示されるアゾ化合物の金属錯体であることを特徴 とする請求項1記載の光記録媒体。

【化2】

$$R_{g} \xrightarrow{N-N} N=N \xrightarrow{R_{g}} R_{4} \xrightarrow{R_{1}} R_{2}$$
 (2)

[式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 、 R_6 R $_5$ 及び R_6 は、式(1) と同じ意味を表し、 R_8 は、ヒドロキシ基またはカルボキシル基を表し、 R_9 は、水素原子またはハロゲン原子を表す。]

【請求項3】 レーザー波長において、記録層の屈折率が1.8以上、且つ、消衰係数が0.04~0.40であることを特徴とする請求項1または2記載の光記録媒体。

【請求項4】 波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項5】 基板に案内溝がスパイラル状にあり、この溝ピッチが $0.5\sim1.2\mu$ mであることを特徴とする請求項 $1\sim4$ のいずれかに記載の光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体、特に 有機色素を含有する追記型光記録媒体において、従来に 比較して高密度に記録及び再生可能な光記録媒体に関す る

[0002]

【従来の技術】コンパクトディスク(以下、CDと略

す) 規格に対応した追記型光記録媒体としてCD-R (CD-Recordable) が提案・開発されてい る [例えば、日経エレクトロニクス No. 465, P. 107, 1989年1月23日号、OPTICAL DATA S TORAGE DIGEST SERIES vol.1 P45, 1989等]。このCD -Rは〔図1〕に示すように透明樹脂基板1上に記録層 2、反射層3、保護層4がこの順で積層されており、該 記録層に高パワーのレーザー光を照射することにより、 記録層が物理的あるいは化学的変化を起こし、ピットの 形で情報を記録する。形成されたピット部位に低パワー のレーザー光を照射し、反射率の変化を検出することに よりピットの情報を再生することができる。このような 光記録媒体の記録・再生には一般に波長770~830 nmの近赤外半導体レーザーを用いており、レッドブッ クやオレンジブック等のCDの規格に準拠しているた め、CDプレーヤーやCD-ROMプレーヤーと互換性 を有するという特徴を有する。

【0003】しかしながら、上記の従来の媒体の記録容量は650MB程度であり、動画の記録を考慮すると容量が十分でなく、情報量の飛躍的増加に伴い情報記録媒体に対する高密度化・大容量化の要求は高まっている。

【0004】また、光ディスクシステムに利用される短 波長半導体レーザーの開発が進み、波長680nm、6 50nm及び635nmの赤色半導体レーザーが実用化 されている [例えば、日経エレクトロニクス、No. 5 92、P. 65、1993年10月11日号]。記録· 再生用レーザーの短波長化および対物レンズの開口数を 大きくすることによりピームスポットを小さくすること ができ、高密度な光記録媒体が可能になる。実際に半導 体レーザーの短波長化、対物レンズの開口数大化、デー タ圧縮技術などにより動画を長時間記録できる大容量の 光記録媒体が開発されてきている[例えば、日経エレク トロニクス、No. 589、P. 55、1993年8月 30日号、No. 594、P. 169、1993年11 月8日号]。最近では、2時間以上の動画をデジタル記 録したデジタルビデオディスク(DVD)が開発されて きた。DVDディスクは4.7GBの記録容量を有する 再生専用の媒体であり、この容量に合った記録可能な光 ディスクの開発がさらに要望されている。

【0005】また、YAGレーザーの高調波変換による532nmのレーザーも実用可されている。

【0006】532nmよりさらに短波長の490nm の青/緑色半導体レーザーも研究されているが、まだ実 用化の段階まで至っていない [例えば、Applied Physics Letter, P. 1272-12

74, Vol. 59 (1991) や日経エレクトロニクスNo. 552, P. 90, 1992年4月27日号]。

【0007】さて、短波長レーザーを使用した場合、光ディスクの線記録密度と半径方向記録密度は理論的には

同等に高密度化できるが、現状では、半径方向の記録密度は線記録密度ほど大きくすることは困難である。レーザー光は構またはランドにより回折散乱されるため、トラックピッチを狭くするほど信号検出光量が低下する。また、十分なトラッキング信号が得られる深さを保ったままトラックピッチを狭くするにも成形上限界がある。また溝が深く狭いと、記録層を均一に成膜することが困難である。さらに、溝とランドのエッジ部分は平滑ではなく微小凹凸があるため、ノイズの原因となる。このとを表慮すると、波長50で急激に生じる。これらのことを考慮すると、波長50mmで対物レンズの開口数が0.6では溝ピッチの限界は約0.5μmと考えられる。

【0008】追記型光記録媒体の色素層にレーザー光を 照射し、物理変化または化学変化を生じさせることでピ ットを形成させる際、色素の光学定数、分解挙動が良好 なピットができるか否かの重要な要素となる。分解しず らいものは感度が低下し、分解が激しいか、または、変 化しやすいものは、ピット間および半径方向のランド部 への影響が大きくなり、信頼性のあるピット形成が困難 になる。従来のCD-R媒体において、高密度で用いら れているレーザー波長では色素層の屈折率も低く、消衰 係数も適度な値ではないため、反射率が低く変調度が取 れなかった。さらには、絞られたビームで小さいピット を開けるべきところが、周りへの影響が大きく分布の大 きいピットになったり、半径方向へのクロストークが悪 化した。逆にピットが極端に小さくなり変調度が取れな い場合もあった。従って、記録層に用いる色素の光学的 性質、分解挙動の適切なものを選択する必要がある。

【0009】例えば、特開平6-199045号公報は、波長680nmの半導体レーザーで記録再生可能な光記録媒体が提案されている。この媒体は、記録層にシアニン色素を用いており高密度の記録再生の可能性は示しているものの、実際に高密度に記録した記述はない。また、特公平5-67438号公報では、アゾ化合物の金属錯体を用いた光記録媒体を提案しているが、短波長のレーザーでの高密度記録及び本発明の構造のヘテロ環を有するアゾ色素についての記述はない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、従来の 光記録媒体では記録層に用いている有機色素が、波長5 20~690nmで吸収が大きく屈折率が小さいまたは 分解挙動が適切でないため、波長520~690nmの 短波長レーザーでの記録及び再生が困難であることを見 出した。そこで本発明の目的は、波長520~690n mの範囲で良好な記録及び再生が可能な高密度記録に適 した光記録媒体を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明を提案する に至った。すなわち、この問題は以下の発明によって解 決される。

【0012】本発明に従えば、記録層に使用する色素を上記のような構造で吸収極大波長が450nm~630nmであるものとすることより、波長520~690nmのレーザー光に対して良好な高密度記録及び再生が可能な光記録媒体が実現される。

【0013】すなわち、本発明は、

① 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光

記録媒体において、該記録層中に波長450~630nmに吸収極大を有する下記式(1) [化3]で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且つ、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記録媒体、

[0014] 【化3】

[式中、R₁及びR₂は各々独立に水素原子、置換また は未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルケニル基を表し、R₃、R₄、R₅及びR₆は 各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、カ ルボキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表し(ここで、金属 錯体を形成する場合は、R₃及びR₅のどちらか一方はヒ ドロキシ基、カルボキシル基、アミノ基、置換または未 置換のアルキルカルボキシル基、置換または未置換のア ルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換のアルキ ルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルアミ ノ基であり、他方は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキ シ基、カルボキシル基、スルホンアミド基、アミノ基、 置換または未置換のアリール基、置換または未置換のア シル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル基、 置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換の アルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換のアル キルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルア ミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、置換 または未置換のアルケニル基を表す。)、R₁とR₄、 R₂ とR₆ 及びR₁ とR₂ は連結基を介して環を形成し てもよく、 R_7 は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ 基、カルボキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、

アミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換または

アルキルカルボキシル基、置換または未置換のアラルキ

基、置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基、置

換または未置換のアルキルアミノ基、置換または未置換

ル基、置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ

未置換のアルコキシ基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアシル基、置換または未置換の のアルキルスルホン基、置換または未置換のアルケニル基、シアノ基、ニトロ基、メルカプト基、チオシアノ基、クロロスルホン基、置換または未置換のアルキルチオ基、置換または未置換のアルキルアシメチン基、置換または未置換のアルキルアシメチン基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルケニル基を表す。)、Yは、窒素原子またはCーR。を表す(ここで、R。はR、と同じ意味を表す。)。但し、Xが硫黄原子の時、Yは、窒素原子であり、XがN-R。の時、Yは、C-R。である。1

② 記録層中に含有する波長450~630nmに吸収極大を有する化合物が、下記式(2) [化4] で示されるアゾ化合物の金属錯体であることを特徴とする①記載の光記録媒体、

[0015]

【化4】

[式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 、 R_5 及び R_6 は、式(1)と同じ意味を表し、 R_8 は、ヒドロキシ基またはカルボキシル基を表し、 R_9 は、水素原子またはハロゲン原子を表す。]

- ③ レーザー波長において、記録層の屈折率が1.8以上、且つ、消衰係数が0.04~0.40であることを 特徴とする①または②記載の光記録媒体、
- ④ 波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることを特徴とする①~③のいずれかに記載の光記録媒体、
- ⑤ 基板に案内溝がスパイラル状にあり、この溝ピッチが $0.5 \sim 1.2 \mu m$ であることを特徴とする \mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{O} いずれかに記載の光記録媒体である。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の具体的な実施の形態につ いて以下に説明する。本発明において光記録媒体とは、 予め情報を記録されている再生専用の光再生専用媒体及 び情報を記録して再生することのできる光記録媒体の両 方を示すものである。但し、ここでは適例として後者の 情報を記録して再生のできる光記録媒体、特に基板上に 記録層、反射層を有する光記録媒体に関して説明する。 この光記録媒体は〔図1〕に示すような基板、記録層、 反射層及び保護層が順次積層している4層構造を有して いるか、〔図2〕に示すような貼り合わせ構造を有して いる。すなわち、基板1'上に記録層2'が形成されて おり、その上に密着して反射層3'が設けられており、 さらにその上に接着層4'を介して基板5'が貼り合わ されている。ただし、記録層2'の下または上に別の層 があってもよく、反射層の上に別の層があってもかまわ ない。

【0017】本発明において基板の材質としては、基本的には記録光及び再生光の波長で透明であればよい。例えば、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料やガラス等の無機材料が利用される。これらの基板材料は射出成形法等により円盤状に基板に成形される。必要に応じて、基板表面に案内溝やピットを形成することもある。このような案内溝やピットは、基板の成形時に付与することが好ましいが、基板の上に紫外線硬化樹脂層を用いて付与することもできる。通常CDとして用いる場合は、厚さ1.2mm程度、直径80ないし120mm程度の円盤状であり、中央に直径15mm程度の穴が開いている。案内溝がスパイラル状の場合、この溝ピッチが0.5~1.2

【0018】本発明においては、基板上に記録層(色素層)を設けるが、本発明の色素層は、 λ max が $450\sim630$ n m付近に存在する式(1)で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有するものである。中でも、520 n m ~690 n m から選択される記録及び再生レーザー波長に対して適度な光学定数を有することが好ましい。

【0019】光学定数は複素屈折率(n+ki)で表現される。式中のn, kは、実数部nと虚数部kに相当する係数である。ここでは、nを屈折率、kを消衰係数とする。

【0020】一般に有機色素は、波長えに対し、屈折率 n と消衰係数 k が大きく変化する特徴がある。この特徴 を考慮して、目的とするレーザー波長において好ましい 光学定数を有する有機色素を選択し記録層を成膜することで、高い反射率を有し、且つ、感度の良い媒体とすることができる。

【0021】本発明によれば、記録層に必要な光学定数

は、前記レーザー光の波長において、nが1.8以上、且つ、kが0.04~0.40であり、好ましくは、nが2.0以上で、且つ、kが0.04~0.20である。nが1.8未満の小さい値になると正確な信号読み取りに必要な反射率と信号変調度は得られず、kが0.40を越えても反射率が低下して良好な再生信号が得られないだけでなく、再生光により信号が変化しやすくなり実用に適さない。

【0022】本発明で用いる色素は、式(1)で示されるアゾ化合物またはその金属錯体であり、式(1)の置換基において、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素であり、好ましくは、フッ素、塩素、臭素である。

【0023】置換または未置換のアルキル基としては、 直鎖または分岐のアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシアルコキシアルキル基、アルコキシアルコキシアルコキシアルキル基、アルコキシカルボニルアルキ ル基、アルコキシカルボニルオキシアルキル基、ヒドロキシアルコキシカルボニルオキシアルキル基、ヒドロキシアルコキシアルキル基、ヒドロキシアルコキシアルキル基、シアノアルキル基、アシルオキシアルコキシアルキル基、アシルオキシアルコキシアルキル基、アシルオキシアルコキシアルキル基、アシルオーシアルキル基、アルキルカルボニルアミノアルキル基、アルキルスルホンアミノアルキル基、スルホンアミドアルキル基、アルキルアミノアルキル基、アルキルアミノアルキル基、アルキルスルホンアルキル基、アルキルスルホンアルキル基の中から選択される。

【0024】ここで直鎖または分岐のアルキル基として は炭素数1~15の炭化水素基で、ポリカーボネート、 アクリル、エポキシ、ポリオレフィン基板等への塗布に よる加工性を考慮すれば、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、 t-プチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、2-メチル ブチル基、1-メチルブチル基、neo-ペンチル基、1,2-ジ メチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、cyclo-ペ ンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチル基、3-メチ ルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペンチル 基、3,3-ジメチルプチル基、2,3-ジメチルプチル基、1, 3-ジメチルプチル基、2,2-ジメチルプチル基、1,2-ジメ チルプチル基、1,1-ジメチルプチル基、3-エチルブチル 基、2-エチルブチル基、1-エチルプチル基、1,2,2-トリ メチルプチル基、1,1,2-トリメチルプチル基、1-エチル -2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル 基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチ ルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペン チル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメ チルヘキシル基、2,5,5-トリメチルペンチル基、2,4-ジ メチルヘキシル基、2,2,4-トリメチルペンチル基、n-ノ ニル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-

4,5- メチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1,3,5,7-テトラエチルオクチル基、4-プチルオクチル基、6,6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチルー4- プチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3,5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-cyclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル基等が挙げられる。

【0025】また、アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、メトキシエチル基、プトキシエチル基、ロースキシルオキシエチル基、イーメチルペントキシエチル基、1、3-ジメチルプトキシエチル基、2-エチルへキシルオキシエチル基、1、3-ジメチルプトキシエチル基、2-エチルへキシルオキシエチル基、1、3-ジメチルプトキシエチル基、2-メチルー1-iso-プロピルプロポキシエチル基、3-メチルー1-iso-プロピルブチルオキシエチル基、3-メチルー1-iso-プロピルブチルオキシエチル基、3-メチルー1-iso-プロピルブチルオキシエチル基、3-メーカー1-メチルエチル基、3-メトキシブチル基、3、3、3-トリフロロプロポキシエチル基などの炭素数2~15のものが挙げられる。

【0026】アルコキシアルコキシアルキル基の例としては、メトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、プトキシエトキシエチル基、プトキシエトキシエチル基、ハキシルオキシエトキシエチル基、1,2-ジメチルプロポキシエトキシエチル基、3-メチル-1-iso-プチルプトキシエトキシエチル基、2-メトキシ-1-メチルエトキシエチル基、2-(2'-エトキシー1'-メチルエトキシー1-メチルエチル基、3,3,3-トリフルオロプロポキシエトキシエチル基、3,3,3-トリクロロプロポキシエトキシエチル基などが挙げられる。

【0027】アルコキシアルコキシアルコキシアルキル 基の例としては、メトキシエトキシエトキシエチル基、 エトキシエトキシエトキシエチル基、プトキシエトキシ エトキシエチル基、2,2,2-トリフルオロエトキシエトキ シエトキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシエトキ シエトキシエチル基などが挙げられる。

【0028】アルコキシカルボニルアルキル基の例としては、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル基、ブトキシカルボニルエチル基、ブトキシカルボニルエチル基、2,2,3,3-テトラフルオロプロポキシカルボニルメチル基、2,2,3,3-テトラクロロプロポキシカルボニルメチル基等が挙げられる。

【0029】アルコキシカルボニルオキシアルキル基の例としては、メトキシカルボニルオキシエチル基、エトキシカルボニルオキシエチル基、プトキシカルボニルオキシエチル基、2,2,2-トリフルオロエトキシカルボニル

オキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル オキシエル基などが挙げられる。

【0030】アルコキシアルコキシカルボニルオキシアルキル基の例としては、メトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、エトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、ブトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、2,2-トリフルオロエトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、2,2-トリクロロエトキシエトキシカルボニルオキシエチル基などが挙げられる。

【0031】ヒドロキシアルキル基の例としては、2-ヒドロキシエチル基、4-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシ-3- メトキシプロピル基、2-ヒドロキシ-3- クロロプロピル基、2-ヒドロキシ-3- エトキシプロピル基、3-ブトキシ-2- ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシー3- フェノキシプロピル基、2-ヒドロキシブチル基などが挙げられる。

【0032】ヒドロキシアルコキシアルキル基の例としては、ヒドロキシエトキシエチル基、2-(2'-ヒドロキー1'-メチルエトキシ) -1- メチルエチル基、2-(3'-フルオロ-2'-ヒドロキシプロポキシ) エチル基などが挙げられ、ヒドロキシアルコキシアルコキシアルキル基の例としては、ヒドロキシエトキシエトキシエチル基、[2'-(2'-ヒドロキ-1'-メチルエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシエチル基、[2'-(2'-フルオロ-1'-ヒドロキシエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシンチルエトキシ] エトキシエチル基、[2'-(2'-クロロ-1'-ヒドロキシエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシエチル基、[2'-(2'-クロロ-1'-ヒドロキシエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシエチルエトキシ] エトキシエチルエトキシ] エトキシエチルエトキシ] エトキシエチルエチルエトキシ] エトキシエチルエチルエトキシ] エトキシエチルエチルエトキシ] エトキシエチルエ

【0033】シアノアルキル基の例としては、2-シアノエチル基、4-シアノブチル基、2-シアノ-3-メトキシプロピル基、2-シアノ-3-クロロプロピル基、2-シアノ-3-エトキシプロピル基、3-ブトキシ-2-シアノプロピル基、2-シアノ-3-フェノキシプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シアノブチル基などが挙げられる。

【0034】アシルオキシアルキル基の例としては、ア セトキシエチル基、プロピオニルオキシエチル基、ブチ リルオキシエチル基、パレリルオキシエチル基、1-エチ ルペンチルカルボニルオキシエチル基、2,4,4-トリメチ ルペンチルカルボニルオキシエチル基、3-フロオロブチ リルオキシエル基、3-クロロブチリルオキシエチル基な どが挙げられ、アシルオキシアルコキシアルキル基の例 としては、アセトキシエトキシエチル基、プロピオニル オキシエトキシエチル基、バレリルオキシエトキシエチ ル基、1-エチルペンチルカルボニルオキシエトキシエチ ル基、2,4,4-トリメチルペンチルカルボニルオキシエト キシエチル基、2-フルオロプロピオニルオキシエトキシ エチル基、2-クロロプロピオニルオキシエトキシエチル 基などが挙げられ、アシルオキシアルコキシアルコキシ アルキル基の例としては、アセトキシエトキシエトキシ エチル基、プロピオニルオキシエトキシエトキシエチル 基、バレリルオキシエトキシエトキシエチル基、1-エチルペンチルカルボニルオキシエトキシエトキシエチル 基、2,4,4-トリメチルペンチルカルボニルオキシエトキシエトキシエチル基、2-フルオロプロピオニルオキシエトキシエトキシエチル基、2-クロロプロピオニルオキシエトキシエトキシエチル基などが挙げられる。

【0035】ハロゲン化アルキル基の例としては、クロルメチル基、クロルエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、トリフルオロメチル基、プロムメチル基、ヨウ化メチル基などが挙げられる。スルホンアルキル基の例としては、スルホンメチル基、スルホンエチル基、スルホンプロピル基などが挙げられる。

【0036】アルキルカルボニルアミノアルキル基の例としては、メチルカルボニルアミノエチル基、エチルカルボニルアミノエチル基、プロピルカルボニルアミノエチル基、シクロヘキシルカルボニルアミノエチル基、スクシンイミノエチル基などが挙げられる。

【0037】アルキルスルホンアミノアルキル基の例としては、メチルスルホンアミノエチル基、エチルスルホンアミノエチル基、プロピルスルホンアミノエチル基などが挙げられる。スルホンアミドアルキル基の例としては、スルホンアミドメチル基、スルホンアミドエチル基、スルホンアミドプロピル基などが挙げられる。

【0038】アルキルアミノアルキル基の例としては、N-メチルアミノメチル基、N,N-ジメチルアミノメチル基、N,N-ジプロピルアミノメチル基、N,N-ジプロピルアミノメチル基、N,N-ジプルアミノメチル基、などが挙げられる。アミノアルキル基の例としては、アミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基などが挙げられる。

【0039】アルキルスルホンアルキル基の例としては、メチルスルホンメチル基、エチルスルホンメチル基、ブチルスルホンエチル基、メチルスルホンエチル基、エチルスルホンエチル基、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルスルホンメチル基などが挙げられる。

【0040】置換または未置換のアルコキシ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルコキシ基であり、好ましくは、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-プトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペントキシ基、iso-ペントキシ基、neo-ペントキシ基、2-メチルブトキシ基などの低級アルコキシ基が挙げられる。

【0041】置換または未置換のアリール基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアリール基であり、好ましくは、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ナフ

チル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基などが挙げられる。

【0042】置換または未置換のアシル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアシル基であり、好ましくは、ホルミル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、n-プロピルカルボニル基、iso-プロピルカルボニル基、sec-ブチルカルボニル基、t-ブチルカルボニル基、n-ペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカルボニル基、コーペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカルボニル本、iso-ペンチルカルボニル本、コースをどが挙げられる。

【0043】置換または未置換のアルキルカルボキシル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルカルボキシル基であり、好ましくは、メチルカルボキシル基、エチルカルボキシル基、ロプロピルカルボキシル基、iso-プロピルカルボキシル基、n-ブチルカルボキシル基、iso-ブチルカルボキシル基、sec-ブチルカルボキシル基、t-プチルカルボキシル基、n-ペンチルカルボキシル基、iso-ペンチルカルボキシル基、neo-ペンチルカルボキシル基、2-メチルブチルカルボキシル基などの低級アルキルカルボキシル基が挙げられる。

【0044】置換または未置換のアラルキル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキル基であり、好ましくは、ベンジル基、ニトロベンジル基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチルメチル基などが挙げられる。

【0045】置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルカルボニルアミノ基であり、好ましくは、メチルカルボニルアミノ基、エチルカルボニルアミノ基、n-プロピルカルボニルアミノ基、iso-プロピルカルボニルアミノ基、n-プチルカルボニルアミノ基、iso-プチルカルボニルアミノ基、sec-ブチルカルボニルアミノ基、t-ブチルカルボニルアミノ基、n-ペンチルカルボニルアミノ基、iso-ペンチルカルボニルアミノ基、noo-ペンチルカルボニルアミノ基、2-メチルブチルカルボニルアミノ基、シクロヘキシルカルボニルアミノ基、スクシンイミノ基などの低級アルキルカルボニルアミノ基が挙げられる。

【0046】置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルスルホンアミノ基であり、好ましくは、メチルスルホンアミノ基、エチルスルホンアミノ

基、n-プロピルスルホンアミノ基、iso-プロピルスルホンアミノ基、n-ブチルスルホンアミノ基、iso-ブチルスルホンアミノ基、t-ブチルスルホンアミノ基、t-ブチルスルホンアミノ基、n-ペンチルスルホンアミノ基、iso-ペンチルスルホンアミノ基、neo-ペンチルスルホンアミノ基、シクロヘキシルスルホンアミノ基などの低級アルキルスルホンアミノ基が挙げられる。

【0047】 置換または未置換のアルキルアミノ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルアミノ基であり、好ましくは、N-メチルアミノ基、N,N-ジエチルアミノ基、N,N-ジプテルアミノ基などの低級アルキルアミノ基が挙げられる。

【0048】置換または未置換のアルキルスルホン基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルスルホン基であり、好ましくは、メチルスルホン基、エチルスルホン基、n-プロピルスルホン基、iso-プロピルスルホン基、iso-ブチルスルホン基、sec-ブチルスルホン基、t-ブチルスルホン基、n-ペンチルスルホン基、iso-ペンチルスルホン基、neo-ペンチルスルホン基、2-メチルブチルスルホン基、2-ヒドロキシエチルスルホン基、2-シアノエチルスルホン基などの低級アルキルスルホン基が挙げられる。

【0049】置換または未置換のアルケニル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルケニル基であり、好ましくは、プロペニル基、1-ブテニル基、iso-ブテニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル-1-ブテニル基、3-メチル-1-ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、2,2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メチルカルボキシルビニル基、2-シアノ-2-メチルスルホンビニル基などの低級アルケニル基が挙げられる。

【0050】置換または未置換のアルキルチオ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルチオ基であり、好ましくは、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、iso-プロピルチオ基、n-プチルチオ基、iso-プチルチオ基、sec-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、iso-ペンチルチオ基、neo-ペンチルチオ基、2-メチルブチルチオ基、メチルカルボキシルエチルチオ基などの低級アルキルチオ基が挙げられる。

【0051】置換または未置換のアルキルアゾメチン基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルアゾメチン基であり、好ましくは、メチルアゾメチン基、エチルアゾメチン基、n-プロピルアゾメチン基、iso-プロピルアゾメチン基、sec-ブチルアゾメチン基、t-ブチルアゾメチン基、n-ペンチルアゾメチン

基、iso-ペンチルアゾメチン基、neo-ペンチルアゾメチン基、2-メチルブチルアゾメチン基、ヒドロキシエチルアゾメチン基などの低級アルキルアゾメチン基が挙げられる。

【0052】置換または未置換のアルキルアミノスルホン基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルアミノスルホン基であり、好ましくは、N-メチルアミノスルホン基、N-エチルアミノスルホン基、N-(n-プロピル)アミノスルホン基、N-(n-プチル)アミノスルホン基、N-(iso-プロピル)アミノスルホン基、N-(iso-ブチル)アミノスルホン基、N-(iso-ブチル)アミノスルホン基、N-(n-ペンチル)アミノスルホン基、N-(n-ペンチル)アミノスルホン基、N-(neo-ペンチル)アミノスルホン基、N-(2- ヒドロキシエチル)アミノスルホン基などの低級アルキルアミノスルホン基が挙げられる。

【0053】 R_1 と R_4 または R_2 と R_6 が連結基を介して環を形成した例としては、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH(C1)-$ 、 $-CH_2C$ (=0) $-CH_2C$ (-1) $-CH_2C$ (-1) -

【0054】本発明の式(1)で表される化合物は、公知の方法により、次の様に製造される。すなわち、式

- (3) 〔化5〕で示されるアミン成分をジアゾ化し、式
- (4) [化5] で示されるカップリング成分の溶液に添加し、カップリング反応させて式(1)で示されるアゾ 化合物が得られる。

[0055]

【化5】

$$R_7 \longrightarrow NH_2$$
 (3)

〔上式**看**、R **R** R へ X 及びYは式(1) の場合と同じ意味を表す。〕

【0056】また、本発明においては、前記アゾ化合物の金属錯体の製造法は公知の方法、例えば、古川; Anal ytica Chimica Acta 140(1982) 281-289に記載の方法等に準じて製造することができる。アゾ化合物の金属錯体

を形成する金属としては、例えば、ニッケル、コバルト、鉄、ルテニウム、オジウム、パラジウム、銅、オスミウム、イリジウム、白金、亜鉛、マグネシウム、マンガン等の金属が好ましく、特にニッケル、コバルト、銅、パラジウム、鉄、亜鉛、マンガンが好ましい。これらは製造時に酢酸塩、ハロゲン化物、BF $^{4-}$ 塩等の形で用いられ、Ni $^{2+}$ 、Co $^{2+}$ 、Co $^{3+}$ 、Cu $^{2+}$ 、Pd $^{2+}$ 、Fe $^{2+}$ 、Fe $^{3+}$ 、Zn $^{2+}$ 、Mn $^{2+}$ 等としてアゾ化合物に

配位した錯体として得られる。このアゾ化合物の金属錯体は、単独でも複数の化合物を混合しても良い。

【0057】この式(1)で示されるアゾ化合物及びその金属錯体の具体例としては、表1[表1]~[表7]及び表2[表8]~[表13]に示す置換基及び配位金属を有する化合物が挙げられる。

【0058】 【表1】

1-1 34,04,044 34,04,044 1 304,		報										
	=	C合物		ay B	æ	4	æ	æ	4	×	>	金属
다음다 2000 다음 다음 다	-	-	HO ² HD ² HD	HD2HD2HD	I	OCH ₃	r	I	క	NCH2O4	3	
다음년다음년다음 H <t< td=""><th>-</th><td>-5</td><td>CH2CH2COCH2</td><td>CH2CH2COCH3</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>±</td><td>ర్</td><td>N-CH2-N</td><td>8</td><td>•</td></t<>	-	-5	CH2CH2COCH2	CH2CH2COCH3	I	I	I	±	ర్	N-CH2-N	8	•
中央のの中央できる中で	-	6.	ಕ್ಷಾಂಕ್ಷಾಂಕ್ಷಾ	ಹಿಂಬಿಯ್ಯ	I	r	I	I	Ŧ	N-OH2QH2	CSCH	
어ଧି 다 나 H <	-	4-	CH, COOCH, CF, CHF,		I	I	I	I	ಕೆ	ACH.	Š	
어난다는 여난다는 여난다는 H H H CH H CH H CH H CH M CH H CH	-	9-1	ප්	40 ⁴ 0	I	r	5	r	క	K-CH3	S	•
中央の場合	-	9-	రో	G FOF	r	I	ቼ	I	ቼ	N CH	8	
中央の4.044 の4.0420000HCM。 H	_	1-7	స్త్రీస్త	CH, CH, NHCOCH,	I	I	₽	I	ಕೆ	ž	Ş	•
中央の中央の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の	_	8-	0%0%0%0	CH2CH2COCHCH3	I	I	ᇹ	r	I	Ŷ	COOCH	•
会長のよう のようなもない 日 日 日 OH	_	6-1	45454546	ଊୄଊ୷ୠ	I	OCH ₂ OH	₹	I	I	N-CH=CHCH3	್ಟ್ ೧೦೦೦೦	
のよっからからいました。 は H H NHCOO% H O% NHCH のよっかっからいたのかっかいでいます。 H H H H H NHCH のないかっかっかっかっかっかっかっかっない。 H H H H NHCH のないかっかっない。 H H H NHCH のないかっかっない。 H H NHCH のないかっかっない。 H H NHCH のないかっかっない。 H H NHCH のないかっかっない。 H H NHCH のない。 H H NHCH のない。 NHCH H NHCH	_	1-10	ත් ත්	c y , c y ,	I	I	NHCOCH ₃	I	₹	N-CH2OH3	SO	
CH2 CH2 H H NHCOCH H CH3 NCH3 CH2 CH2 CH2 CH3	_	1-11	CH, CH, CH, CH	arararar	I	I	NHCOCH	I	ಕೆ		cccch ₂ ch	•
Офесифосифосифосифосифосифосифосифосифосифо	_	1-12	्र ह	P E	I	I	NHCOCHS	I	కో	ACH.	COONT	
Стратада от стратат н н мисост н от	-	1-13)₂ ದ್ಯಾರ್ಡಿಂದಿ(೧೫,)₂	I	I	NHCOCH	I	I	K CH3	COO H	
atentation at attached to the minimum of the attached attached to the minimum of the attached to the attached	_	1-14		 ,	I	I	NHCOCH	I	కే	Ŷ	900	(^
Change, Charachard H H NHCO-(H) H Ch	•	1-15	ť	Sep on	I	8	NHOOOH	I	र्ड	ž	() voso	(^
	_	1-16		94,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04	I	r	NHCO H	I	ર્ક	Ŧ	C-NO2	

[0059]

【表2】

(しがき)

1	(3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,									1
化合物	Æ	æ	æ	ď	æ	æ	æ	×	>	金属
1-17		CHOOCH2G2OF2 CHOOCCH2G2OH2	I	I	NHCO H	r	I	N-CH2QH2	8	
1-18	G2,04,04,04,	ᢞᠣᡟᡃᠦᡟᠣ	I	I	NHCO (I	б	Ŷ	5	
1-19	94,94,94	Ф ,Ф,Ф	I	£	NHOO	I	కో	N-CH2CH3	S	
1-20	<u> </u>	ಭ್ರ ಭ್ರಭ್ರ ಭ	I	I	н руручроон	Σ Σ	I	N-GH2	COOOCH	•
1-21	Rと被指	R。と連結	I	(CH ₂) ₃	ច	(CH ₂) ₃	I	NCH3	C-NO2	•
1-22	Rと連結	R。と連結	I	CH, COCH,	రే	ക്കാന് കുവ്	ያ	ž	ş	
1-23	Roと連結	CH, CH, CCH, CH ₂	I	r	NHCOCH	I	ዿ	Ę	CCCCCH	,
1-24	G. C.	I	I	I	8	I	Ū	ž	СВОЗН	•
1-25	CH2CH2CH3	I	I	I	SO _H	I	రో	Ī	CSO ₂ NH ₂	
1-26	CH, CH, CH, CH,	0	I	I	SO ₂ NH ₂	r	కో	ž	C-NH ₂	
1-27	OHECHCH,	0+0HO	I	I	NH ₂	I	కో	ž	COCH	
1-28	ಈ ಈ ಈ ಈ	೧ <u>೪</u> .೦೪,೦೪	I	I	, 10000	I	ర్	ž	Ç	
1-29	ଫ୍ୟୁଫ୍ୟୁ	ᢞᠣᢝᡆᢝᡆᢞ	I	r	NHSO ₂ CH ₃	I	ธ์	Ē	Or O	
1-30	04,04,040	a 2,04,04,04	I	I	0	r	కో	¥	C-NHCOCH ₃	•
1-31	CH, CH, CH, CH,	CH, CH, CH, CH	I	I	8	I	I	ž	. CANHSO2CH3	
1-32	CHECHECHECHE	<u> </u>	I	I	P &	I	I	Ĭ	C-N(CH ₃) ₂	

【0060】 【表3】

【0061】 【表4】

化合物	Œ	æ	æ	ď	æ	8	æ	×	>	金属
1-33	chichichichi	๛๚๛๚๛	I	I	NH(CH ₃) ₂	I	I	Ž Ž	%0H03	
1-34	₽,0 <u>₹</u> 0	ക്ക്ക	I	I	% ଅନ୍ୟୁ	I	I	R CH3	CSH CSH	1
1-35	CH2CH2CH	₽4040	I	I	CHCHCH3	I	I	Ē	CSCN	•
1-36	10 %0%	ଫୃଫୃଫ	I	I	I	I	₽	N-CH ₃	ප ්රිපට	•
1-37	CH2CH2CH	Ю , Ф ,	±	Ξ	x	I	I	¥	- HO4-04-0H	8
1-38	40404b	868	I	I	I	I	I	¥	CSO ₂ NHCH ₃	

表1(つづき

表1(つづき)

化合物			c	•	C	C	1			
1.20	Œ	8	۱ع	Z	عي	۳	4	×	>	金属
2	Q2Q42Q4	CH2CH2CH	I	8	I	I	र्ह	v	z	٠
1-40	сн _е сн _е соссн _е	CH, CH, COOCH,	I	I	I	I	ชื	S	z	•
1-41	೧ ೧೩ ೧೩ ೧೩	CH2CH2CH2 CH2CH2CH2	I	I	I	I	င်္ဂ	v	z	•
1-42	CH3COCCH2CF2CHF2	CH,COCH,CF,CHF2	I	r	I	I	I	Ø	z	•
1-43	ਰੂ-ਨੂ-	QF ₂ QF ₃	I	I	£	r	I	Ø	z	•
1-44	CH2CH2CH2CH3	क्ष्यम् विक्ष	I	I	¥	I	r	ω	z	•
1-45	ಕ್ಕಿದ್ದ	CH ₂ CH ₃	I	I	₽	I	ō	S	z	•
1-46	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₂ NHCOCH ₃	I	I	₽	I	ğ	Ø	z	•
	on on one ch	ан ан оссисна	I	I	£	I	NO ₂	Ø	z	•
1-48	ᢗᢋᢙᡒᡋᡒᠪᠲ	ፙፙፙፙ	I	904,043	£	I	ξ	Ø	2	•
1-49	.	85	I	I	NHCOCH	I	ă	S	z	•
1.50	CH2CH2OCH2CH3	CH2CH2CCH2CH2	I	I	N-HOOOH3	I	ă	ဟ	z	•
1-51	P E	P &	I	I	NHCOOH,	I	ă	Ø	z	•
1-52	CH2CH2CCH2CH(CH3);	04204204(0H3)2 CH2CH2004604(CH3)2	I	I	NHCOCH ₃	I	ă	S	z	ı
1-53	CH, CH, CH,	45454545	r	I	NHCOCH	I	I	Ø	z	:
1-54	CH2CH3	CH2CH2CN	I	8	NHCOCH	I	SO ₂ OH ₃	Ø	z	

[0062]

Z > N(CH(CH₃)₂)₂ CH2COCH2 (CH₂)₃ æ NHCOCH, CH.C NHCOCH CH2COCH2 (CH₃)₂ ď CHOOCH CF. CHOOCH CF. CHF. ೧೪೦೪೦೪ **೧೫,೦೪,೦೪,೦**೪, ᡩᢍᢆᠼᢐ **೧**೫,೦೫,೦೫,೦೫ CH2CH2CH2CH3 CH2CH2COH2CH2 CH2CH2CH3CH3 CH₂CH₂OH CH2 CH2 OH CH2CH2CH **₽**2₽ 924 £ E Rと連結 Reと連結 Granda ಈ ೧೫, ೧೫, ೧೩, CH2 CH2 CH2 CH3 മൂവുവുവു CH, CH, CH, CH2CH2CH3 сысы,он CH2CH2OH GH, CH, OH Œ ફુ CH₂QH₃ £ E Reと連結 R上連結 R、七連結 表1(しがき) 化合物 1-56 1-70 1-59 1-60 1-69 1-65 1-57 1-58 1-68 1-62 1-65 1-86 1-61 1-63 1-64 1-67

[0063]

【表6】

¥	表1(つつぎ)	The second second second								
化合物	Ŗ	a	æ	2	4	æ	4	×	>	金屬
1-71	64.04.04 ,	I	r	I	8 F	I	₽	Ø	z	
1-72	CH, CH, CH, CH,	0	I	I	8 Hg	r	8	Ø	z	
1-73	CH CH CH	CH=CHCH	I	I	SO ₂ NH ₂	r	S H	Ŋ	z	
1-74	CH2CH2CH3	Chatatata	I	I	NHZ	I	SO ₂ NH ₂	æ	z	
1-75	CH2CH2CH3	Chohohoh	I	x	0	I	NH2	ω	Z	•
1-78	5	₽ ₽	I	I	\$	I	ð	w	z	
1-77	8	ಕ್ಕಿಂಕ	I	I	COOCH	I	0	υ	z	
1-78	₽	to to	I	Ι	Q F	I	8	w	2	
1.79	Б	ይ የ	I	I	NHSO ₂ CH ₃	I	жосн ²	ω	z	
1-80	ትዕች	₽ <u>~</u> ₽	τ	I	N(CH ₃) ₂	I	O F	ဟ	z	•
1-81	CH2CH2CH	1 0,40,45	r	τ	SO ₂ CH ₃	I	NHOOCH ₃	ß	z	
1-82	QH2QH2QH	GF, GF, QF	I	I	CH=CHCH3	I	NHSO ₂ CH ₃	W	z	
1-83	то к ожо	но4ю4ю	I	I	NHCO H	I	N(CH _S) ₂	Ø	z	•
1-84	CH2CH2OH	r	r	I	NHCO-H	I	CH=CHCH ₃	Ø	z	
1-85	НОНО	ಕ್ಕಾರಿ	I	Ī	H-OOHN	I	₹.	. ග	z	•
1-86	£	ዯ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	I	I	NHOO H	I	SCN	S	z	,

【0064】 【表7】

【0065】 【表8】

化合物 R ₁ R ₂ R ₂ R ₃ R ₄ R ₅ R ₇ X Y 金属 1-87 Gh ₂ Gh ₃ H ₂ H ₃ H ₄ H ₄ H ₄ H ₄ H ₄ So ₂ MHCH ₃ S N - 1-89 Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ Gh ₄ H ₄ H ₄ Gh ₅ Bi O N 1-90 Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ H ₄ H ₄ H ₄ So ₂ MHCH ₃ O N 1-91 Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ H ₄ H ₄ N+GO ₂ MHCH ₃ O N 1-92 Gh ₂ Gh ₃ Gh ₂ Gh ₃ H ₄ H ₄ N+GO ₂ MHCH ₃ O N			0.000			and the second second					
Офесия Офесия Н Н Н Н Н Н SOZANHCH3 Офесия Офесия ОН2ОНЗ Н Н Н Н Вг Офесия Офесия ОН2ОНЗ Н Н Н Н SOZANHCH3 Офесия Офесия Н Н Н Н КМОООООООООООООООООООООООООООООООООООО	化合物	Æ	æ	В	改	R	Re	B,	×	7	
CH2CH3 H H H H H SO2NHCH3 CH2CH3 CH2CH3 CH2CH4 H H H H H SO2NHCH3 CH2CH3 CH2CH4 H H H H SO2NHCH3 CH2CH4 CH2CH4 H H H SO2NHCH3	1-87	or ₂ or ₃	ଫୃଫ୍ସ	I	I	NHCO-H	I	වරිග	S	z	
Фъдов ОН-СИВ ОН Н Н Н ВГ Фъдов СИБОВ Н Н Н Н SO2NHCH3 Фъдов СИБОВ Н Н Н Н SO2NHCH3 Фъдов СИБОВ Н Н Н Н NHOOD— Н Н SO2NHCH3	1-88	ಕ್ಕಿಂಗ್ಲ	GP ₂ Q ₃	I	I	NHOO-H)	I	SO ₂ NHCH ₃	S	z	•
Оф. От. От	1-89	ජි ජි	දි දි	푱	I	I	ર્ક	ā	0	z	
ОФЕОН СФЕОН Н <th< td=""><td>1-90</td><td>£,45</td><td>9</td><td>I</td><td>I</td><td>NHCO-(H)</td><td>I</td><td>SO₂NHCH₃</td><td>0</td><td>z</td><td></td></th<>	1-90	£,45	9	I	I	NHCO-(H)	I	SO ₂ NHCH ₃	0	z	
CH2CH3 CH2CH3 H H NHCO-{H} H SO2NHCH3	1-91	ಕ್ಕಿಂಗ್	85.8	8 4	r	I	I	D Sos	0	z	
	1-92	ନ୍ଦ୍ର	සූදු	I	I	NHCO-(H)	I	SO ₂ NHCH ₃	0	z	

化合物	Ł	a. L	æ	2	عے	B	æ	×	>	金属
2-1	^೩ ದಿತ್ಗರ್ತಿಗು	ಆ, ಯ, ಯ, ಯ,	8	I	I	I	క	N-CH2OH3	8	Z
2-2	CH2CH2CH2CH3	ᢗᡟᢋᢗᡮ᠐ᢗᡮᢗᡟ	N-HOOD-R	I	I	90 F	\mathcal{E}	NO ₂	8	Ż
2-3	P 3	P	N-1000Hg	S H	I	H ₂ O ₂	I	N-CH ₂ OH ₃	C-SCH ₂	æ
2-4	CH2CH2CCH2CH(CH3)2	೧೪೬೦೫-೦೦೪-೦೧(೦೫), ೧೬೮೩-೦೦೫-೦೧(೦೪),	NHOOOH	I	I	ı	ర్	N-CH3	NO C	ž
2-6	8	*ਠ*ਲ	₹	I	I	I	క	N-CH ₃	Ş	Ē
2-6	ಈಈಈ	ಈ ಯ್ಯಯ	£	I	I	I	3	N-CH ₃	8	Ē
2-7	CH2CH2(CH3)2	CH2CH2CH(CH3)2	N-FCOCH ₃	ō	I	ō	రో	Ī	S C	Ą
2-8	ᢗᢢᡚᡘᡚ	๛๛๛๛	8	I	I	I	I		20000	ž
6-2 【表	454545	CH2CH2CH3	₹	I	I	I	I	NOH=CHEH3	C-COOCH3	Ž
[-S	HO%O%	QH2QH2QH	N+CO+F	I	I	₹	ᅙ	N-CH ₂ GH ₃	CO	2
2-11	H04004040H	CH2CH2CH2CH	NHOOCH	I	I	NHCOCH	ర్	Ę	CCCCCF.	Ą
2-12	њф.	4040	₹	I	T	r	క	NCH3	C-CONH2	Z
2-13	CHECHINHSOS CHE	CH2 CH2 NHSO2 CH3	₹	I	r	I	I	NCH.	C-000H	Ë
2-14	ಭ್ಯಭ್ಯಭ್ಯ ಭ್ಯ	<i>ᠳ</i> ᡂᢪᡂᢪ	₹	I	I	I	క	on On	000	ž
2-15	CH2CH2CH2CH3	ᢗᢋᢗᢋᢗᢢ᠐ᢋ	₹	I	I	I	ર્દ	H	() 2087	ž
2-16	CH2CH2	ಈ ಚ	¥005	=	Ξ	I	ठ	¥	CANO	ž

(0066) 3 4

(しが数)

ì										-
化合物	F.	Pe	æ	ď	ď	æ	æ	×	>	金属
2-17	ಚಿನಂತೆ ಈ ನಿರಾತಿ ಚಿ	CH2004PCH20CH3	HOOD	I	I	I	I	N-CH ₂ GH ₃	Ş	Z
2-18	CHECK NHCOCH	CH2CH2NHCOCH3	8	8	I	I	క		8	Z
2-19	CH-CH-CCH-CH(CH-1),	CH2CH2CH(CH3), CH2CH2CCH2CH3)2	8	H _C O ₃	I	H _C O _S	ಕೆ	N-CH ₂ QH ₃	8	ž
2-20	ර්	\$	NHSO ₂ CH ₃	I	Ę	I	I	NCH ₂	NCH2 COOCH, CH.	ž
2-21	G,G,G,G,G	on on on on	8	I	r	NH3O2CH3	I	N-CH3	C-NO2	ž
2-52	9494949	Open, Open	£	I	I	I	ଫ୍ଲସ୍ଟ	Ī	2	Z
2-23	CH, CH, SO, CH	ಈ ಜ್ಯಾಬ್ಬ್ ಆ	₹	8 8	I	I	CH ₂ Q ₄ s	Ŧ	CCCC	Co(3+)
2-24	9242004p	CH2COCH2CH2	₹	OCH ₂ CH ₃	I	I	δ	¥	С	Co(2+)
2-25	₽°FO	GH2 GH2 OH	5	I	I	r S	కో	ī	C-SO ₂ NH ₂	P.
2-26	CH2COCH2CF2CHF2	chacochachall	I	SOCH CH	I	I	£	Ä	CNH2	5
2-27	ው የተ	6 ,9,9	₹	I	I	Q to	క	ĭ	COCH	Ž
2-28	GY₂CH=CH₂	CH2CH2	₹	Í	I	P	£	H	Ç	ន
2-29	CH-CH-CH-CH-	OH OH CHICH	8	I	I	క	క	Ī	COH _R OS	គ
2-30	Ŷ	I	8	I	I	I	ర్	¥	C-NHCOCH ₃	2
2-31	₽ ₽	8	8 1	ı	r	NHSO ₃ H	r	¥	C-NHSO ₂ CH ₃	Co(3+)
2-35	6	OH2 OH3	HO00	I	I	SO ₂ CH ₃	I	HN.	C-N(CH ₃) ₂	ž
		The same of the sa								

【0067】 | ² | ³ |

【0068】 【表11】

	200	2000					I			I	
化合物	Æ	ď	Б	ď	æ	æ	æ	×	>	Y.A	金属
2-33	野東子 ⁴ 8	CH_CH_NHCOCH,	8	I	I	I	I	S C E	C-CH=CHCH ₆	表	Z
2-34	RAと連結	Reと連結	₽	(CH ₂) ₃	I	(CH ₂) ₃	I	₹o¥	मु		Mn(2+)
2-35	RAと連結	Reと連結	₽	ch, coch	I	900% 900%	I	¥	SSC	7	ž
2-36	Фффф	क्रिक्र क	푱	I	I	I	₹	ž Ž	CSO2G	ō	Ë
2-37	Р	ch,ch,ch	8 F	I	I	I	I	¥	CCH=NCH2CH3	ş	Ē
2-38	ന്മൻൻൻ	30404040	£	=	I	I	ξ	NCH ₂	§	_	Z
2-39	ፙጜ	6 404	₹	I	I	I	ક	NCH2Q16Q13Q13	SOT CON	_	Z
2-40	ದ್ಯಾರ್ಥವ್ಯ ದ್ಯಾರ್ಥವ್ಯ	CH2 CH2 CH3	₽	I	r	I	8	NCH2046046046 C.ON	ಕ್ಷಾ		Cu(2+)

[0069]										
表2	表2 (つづき)									
化合物	£.	Вē	R	4	æ	Re	Ъ	×	>	金属
2-41	ರ್ಷ್ಚರ್ಭರ್ಭ	aronaron	₹	I	I	I	†	Ø	z	ź
2-42	G4,004,0043	CH2CH2CH3	NHCOCHS	I	I	ਝੁੰ	ă	S	z	Ē
2-43	्र ह	P &	NHCOCH	8 H	I	жозн	£	Ø	z	2
2-44	ಈದಿ+ುದ್+ುದ⊬ದಿ+)₂	2-44 0-20-20-20-10-4)2 012-01-20-10-4)2	NHCOCH	I	I	I	ğ	S	z	Ē
2-45	of of	oror.	₹	I	I	I	I	Ø	z	Ē
2-46	क.क.क. क.	CH2CH2CH3	5	I	I	I	I	Ø	z	Ż.
2-47	CH2CH(CH3)2	с 1,201,201,2	NHCOCH ₃	ō	I	ō	I	S	z	Zu
2-48	OP OP OP OP	CH, CH, CH,	ቼ	I	I	I	0	ø	z	ž
子 1 2 4 4 9	04,04,046	ಈಂ ಭಿಂಭಿಂಭ	₹	I	I	I	Đ.	S	z	Z
2-20	Q2,Q2,Q4	Po-to-to	M-co-H	I	I	₹	1 00	Ŋ	z	2
2-51	CH2CH2OCH2OH	п истонной	NHCOCH	I	I	NHCOOHs	ı	S	z	Z,
2-52	% О [#] О	CH ₂ CH ₃	₹	I	I	r	8	S	z	ž
2-63	CH2CH2NHSO2CH3	CHO COSTANTO CH3	₹	I	I	I	ф	s)	z	Z
2-54	CH2CH2CH2CH3	ON ON ON ON	₹	I	I	I	SCH, CH,	S	z	Ē
2-55	CH2CH2CH2	CH2CH2CH2CH3	₹	I	I	I	윰	တ	z	Ż

[0070]

	(5)									1
化合物	Æ	æ	æ	ď	æ	Pe	P.	×	>	金属
2.56	Gr. Of.	ಧ್ಯರ್ಥ	H000	I	I	I	SO ₂ CI	Ø	z	Ž
2.57	CH20CH2CH3	CH2OCH2CH3	8 F	ı	I	I	မ်ဳ	S	z	Ż
2-58	CH2 CH2 NHCOCH5	CH, CH, NHCOCH,	800 HO	90 H	I	I	S	s	z	Ž
2-59	Ф ₂ Ф ₂ ФСФ(СР ₅) ₂	೦೪೬೦೪,೦೦೫,೦೫(೦೪)2 ೧೩೯೦೪,೦೦೫,೦೫(೧೫)2	₹	E S	I	S F	Š N	Ø	z	Ž
2-60	₹ 0₹	₽	NHSO ₂ CH ₂	I	Ĭ,	I	Š	Ø	z	Z
2-61	CH-CH-CH-CH-	CH2CH2CH2	₹	I	I	NHSO ₂ CH ₃	SO ₂ CH ₃	Ø	z	2
2-62	CH2CH2CH2	ದ್ಯು ರಗ್ತರಗ್ರ	₹	I	I	I	SCH2000CH2CH3	Ø	z	Z
-83 -83	G4:C45:C043	ಧ್ಯಧ್ಯುಲ್ಲಿದ್ದ	8	жс к	I	I	CHIN=NCH2 CH3	ø	z	Co(2+
表 ⁴ 3	CH COCH CH	CH ₂ COCH ₂ CH ₃	₽	OCH CH	I	I	N(CH(CH ₃) ₂) ₂	S	z	Z
2.65	CH2CH2CH	₽ ₂ ₽ ₂ OH	NHCOCH	I	I	NHCH3	1 000	Ø	z	2
2-66	CH2COOCH2CF2CHF2	CH2COOCH2CF2CHF2	푱	COOCH ₂ CH ₃	I	I	S H S	S	z	Z
2-67	92920 92920	04040N	₹	I	I	Ŷ	, EHZ	Ø	z	ž
2-68	40#0 # 0	CH2CH=CH2	£	I	I	0	0	Ø	z	ź
5-69	CH2CH2CH3	ᡩᠣᡲᡂᡲᡆᡥ	£	.	I	ਲੌਂ	фснусн	s	z	Ę,
2-70	0	I	₹	I	I	I	сросн	တ	z	Zu
Į										

× v	×2 / 1 - 2 /									
聚合物	R	æ	န	잗	P _P	Re	£.	×	>	金属
F 企 な	GF ₂ CH ₃	G*G4	₹	I	I	NHSO ₂ H	OF THE	Ø	z	Co(3+)
₹-72	88.8	45	₹	r	I	80°G4	NHCOCH	S	z	Z
秦-73	R, と連結	CH2CH2NHCOCH2	₹	I	I	I	NHSO ₂ CH ₃	S	2	Z
₽ . 74	R. と連結	Re 上进館	₹	(CH ₂) ₃	I	(CH ₂) ₃	Q+EQHCH ₃	Ø	z	Z
P-75	RA と連結	Reと連結	ŧ	900g	I	CH,000H2	盂	Ø	z	Ż
92-2長	GF, CF3	45 75	8 H	I	r	ин Возн	P Š	٥	z	Co(3+)
2-77	5	CHECH	8 P	8	I	SO2CH	N-FOOOH	0	z	Ž
第2-78	R. と連結	CH2CH2NHCOCH2	ᅙ	I	I	I	NHSO ₂ CH ₃ O	0	z	Ž
7										

【0071】また、記録特性などの改善のだめに、波長450~630nmに吸収極大を有し、520~690nmでの屈折率が大きい、前記以外の色素と混合してもよい。具体的には、シアニン系色素、スクアリリウム系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、ポルフィリン系色素、テトラピラポルフィラジン系色素、インドフェノール系色素、ピリリウム系色素、チオピリリウム系色素、アズレニウム系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテン系色素、インダゴ系色素、チオインジゴ系色素、メロシアニン系色素、ビスピロメテン系色素、チアジン系色素、アクリジン系色素、オキサジン系色素などがあるが、好ましく

は、ポルフィリン系色素、シアニン系、ビスピロメテン 系色素であり、複数の色素の混合であってもよい。これ らの色素の混合割合は、0.1~30%程度である。

【0072】記録層を成膜する際に、必要に応じて、前 記の色素に、クエンチャー、色素熱分解促進剤、紫外線 吸収剤、接着剤等の添加剤を混合か、あるいは、そのよ うな効果を有する基を置換基として導入することも可能 である。

【0073】なお、クエンチャーとしては、アセチルアセトナート系、ビスジチオーαージケトン系やビスフェニルジチオール系などのビスジチオール系、チオカテコール系、サリチルアルデヒドオキシム系、チオビスフェ

ノレート系等の金属錯体が好ましい。またアミン系も好 適である。

【0074】色素の熱分解促進剤としては、例えば、金 属系アンチノッキング剤、メタロセン化合物、アセチル アセトナト系金属錯体等の金属化合物が挙げられる。

【0075】さらに、必要に応じて、バインダー、レベリング剤、消泡剤等を併用することもできる。好ましいバインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ケトン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリオレフィン等が挙げられる。

【0076】また、色素層を基板の上に成膜する際に、 基板の耐溶剤性や反射率、記録感度等を向上させるため に、基板の上にあらかじめ無機物やポリマーからなる層 を設けても良い。

【0077】本発明において記録層としての、色素層における式(1)で表されるアゾ化合物またはその金属錯体の含有量は、30%以上、好ましくは60%以上である。尚、実質的に100%であることも好ましい。

【0078】色素層を設ける方法は、例えば、スピンコート法、スプレー法、キャスト法、浸漬法等の塗布法、スパッタ法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられるが、スピンコート法が簡便で好ましい。

【0079】ここでスピンコート法等の塗布法を用いる 場合には、式(1)で表されるアゾ化合物またはその金 属錯体(以下色素ともいう)を1~40重量%、好まし くは3~30重量%となるように溶媒に溶解あるいは分 散させた塗布液を用いる。この際、溶媒は基板にダメー ジを与えないものを選ぶことが好ましい。例えば、メタ ノール、エタノール、イソプロピルアルコール、オクタ フルオロペンタノール、アリルアルコール、メチルセロ ソルブ、エチルセロソルブ、テトラフルオロプロパノー ル等のアルコール系溶媒:ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン、デカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、 エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン等の脂 防族又は脂環式炭化水素系溶媒: トルエン、キシレン、 ベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒;四塩化炭素、クロ ロホルム、テトラクロロエタン、ジプロモエタン等のハ ロゲン化炭化水素系溶媒:ジエチルエーテル、ジブチル エーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン等のエ ーテル系溶媒;アセトン、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-プタノン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、乳酸メチル等 のエステル系溶媒、水などが挙げられる。これらは、単 独で用いてもよく、或いは、複数混合して用いてもよ

【0080】なお、必要に応じて、記録層の色素を高分子薄膜などに分散して用いたりすることもできる。また、基板にダメージを与えない溶媒を選択できない場合は、スパッタ法、化学蒸着法や真空蒸着法などが有効で

ある。

【0081】色素層の膜厚は、特に限定するものではな いが、好ましくは50~300nmである。色素層の膜 厚を50nmよりあまり薄くすると、熱拡散が大きいた め記録出来ないか、記録信号に歪みが発生する上、信号 振幅が小さくなる。また、膜厚が300nmよりあまり 厚い場合は反射率が低下し、再生信号特性が悪化する。 【0082】次に記録層の上に、好ましくは、厚さ50 ~300 n mの反射層を形成する。反射層の材料として は、再生光の波長で反射率の十分高いもの、例えば、A u, Al, Ag, Cu, Ti, Cr, Ni, Pt, T a、Cr及びPdの金属を単独あるいは合金にして用い ることが可能である。この中でもAu、Al、Agは反 射率が高く反射層の材料として適している。これ以外で も下記のものを含んでいてもよい。例えば、Mg、S e, Hf, V, Nb, Ru, W, Mn, Re, Fe, C o, Rh, Ir, Cu, Zn, Cd, Ga, In, S i、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの金属及 び半金属を挙げることができる。また、Auを主成分と しているものは反射率の高い反射層が容易に得られるた め好適である。ここで主成分とは含有率が50%以上の ものをいう。金属以外の材料で低屈折率薄膜と高屈折率 薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射層として 用いることも可能である。

【0083】反射層を形成する方法としては、例えば、スパッタ法、イオンプレーテイング法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられる。また、基板の上や反射層の下に反射率の向上、記録特性の改善、密着性の向上等のために公知の無機系または有機系の中間層、接着層を設けることもできる。

【0084】さらに、反射層の上の保護層の材料として は、反射層を外力から保護するものであれば特に限定し ない。有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹 脂、電子線硬化性樹脂、UV硬化性樹脂等を挙げること ができる。また、無機物質としては、SiO。、SiN 4、MgF₂、SnO₂等が挙げられる。熱可塑性樹 脂、熱硬化性樹脂などは適当な溶剤に溶解して塗布液を 塗布し、乾燥することによって形成することができる。 UV硬化性樹脂は、そのままもしくは適当な溶剤に溶解 して塗布液を調製した後にこの塗布液を塗布し、UV光 を照射して硬化させることによって形成することができ る。UV硬化性樹脂としては、例えば、ウレタンアクリ レート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレ ートなどのアクリレート樹脂を用いることができる。こ れらの材料は単独であるいは混合して用いてもよいし、 1層だけでなく多層膜にして用いてもよい。

【0085】保護層の形成の方法としては、記録層と同様にスピンコート法やキャスト法などの塗布法やスパッタ法や化学蒸着法等の方法が用いられるが、この中でもスピンコート法が好ましい。

【0086】保護層の膜厚は、一般には0. $1\sim100$ μ mの範囲であるが、本発明においては、 $3\sim30$ μ m であり、好ましくは $5\sim20$ μ mがより好ましい。

【0087】保護層の上に更にレーベル等の印刷を行うこともできる。

【0088】また、反射層面に保護シートまたは基板を貼り合わせる、あるいは反射層面相互を内側とし対向させ光記録媒体2枚を貼り合わせる等の手段を用いてもよい。基板鏡面側に、表面保護やゴミ等の付着防止のために紫外線硬化樹脂、無機系薄膜等を成膜してもよい。

【0089】かくして形成された本発明の光記録媒体は、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることが好ましい。

【0090】本発明でいう波長520~690nmのレーザーは、特に限定はないが、例えば、可視領域の広範囲で波長選択のできる色素レーザーや、波長633nmのヘリウムネオンレーザー、最近開発されている波長680、650、635nm付近の高出力半導体レーザー、波長532nmの高調波変換YAGレーザーなどが挙げられる。本発明では、これらから選択される一波長または複数波長において高密度記録及び再生が可能となる。

[0091]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれによりなんら限定されるものではない。

〔実施例1〕式(1)で表されるアゾ化合物のうち、

[表 1 1] に記載された化合物 (2-49) 0. 2 g を 2, 2, 3, 3-テトラフルオロ-1- プロパノール (東京化成品) 1 0 m 1 に溶解し、色素溶液を調製した。 基板は、ポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ: 0. 8 μ m)を有する直径 1 2 0 m m ϕ 、厚さ 1. 2 m mの円盤状のものを用いた。

【0092】この基板上に色素溶液を回転数1500rpmでスピンコートし、70℃3時間乾燥して、記録層を形成した。この記録層の吸収極大は540nmであり、光学定数は、680nmではnが2.1、kは0.04であり、650nmではnが2.2、kは0.05であり、635nmではnが2.3、kは0.07であろ

【0093】この記録層の上にバルザース社製スパッタ 装置 (CDI-900) を用いてAuをスパッタし、厚 さ100nmの反射層を形成した。スパッタガスには、アルゴンガスを用いた。スパッタ条件は、スパッタパワー2.5kW、スパッタガス圧1. 0×10^{-2} Torrで行った。

【0094】さらに反射層の上に紫外線硬化樹脂SD-17 (大日本インキ化学工業製)をスピンコートした 後、紫外線照射して厚さ6μmの保護層を形成し、光記 録媒体を作製した。 【0095】得られた光記録媒体に、波長635nmでレンズの開口数が0.6の半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度3.5m/s、レーザーパワー8mWで最短ピット長0.44μmになるように記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッド(レンズの開口数は0.6)を搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0096】次に680nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度1.4m/s、レーザーパワー10mWで最短ピット長0.60μmになるように記録した。この記録した媒体を680nm、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した。いずれも良好な値を示した。

【0097】このように、この媒体は複数のレーザー波 長で記録及び再生を良好に行うことが出来た。なお、エ ラーレートはケンウッド社製CDデコーダー(DR35 52)を用いて計測し、変調度は以下の式により求め た。

変調度= { (信号の最大強度) - (信号の最小強度) } / (信号の最大強度)

【0098】 [実施例2] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ:0.8 μ m)を有する直径120 \min φ、厚さ0.6 \min のを用いる以外は実施例1と同様にして塗布及び反射層を形成した。

【0099】さらに反射層上に紫外線硬化性接着剤SD-301(大日本インキ化学工業製)をスピンコートし、その上にポリカーボネート樹脂製で直径120mm ゆ、厚さ0.6mmの円盤状基板を乗せた後、紫外線照射して貼り合わせした光記録媒体を作製した。作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0100】 [実施例3] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ:1.2 μ m)を有する直径120mm ϕ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0101】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0102】 [実施例4] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ: 0.7 μ m)を有する直径120mm ϕ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0103】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0104】 [実施例5~29] [表8]、[表9]、 [表10] および[表12] に記載したアゾ化合物 (2-1~2-6[表8], 2-19~2-24 [表9], 2-33~2-35[表10], 2-57~2-66 [表12]) を用いる以外は、実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0105】作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0106】 [実施例30] [表5] に記載したアゾ化合物 (1-65) と塗布溶媒としてジアセトンアルコール (東京化成品)を用い、基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ:0.53 μ m)を有する直径120mm ϕ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0107】この記録層の吸収極大は480nmであり、光学定数は、532nmではnが2.4、kは0.15である。

【0108】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した532nmYAG高調波変換レーザーヘッドを搭載した光ディスク評価装置及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度3.8m/s、レーザーパワー7mWで記録した。記録後、同評価装置を用いて信号を再生した結果、反射率は約51%、エラーレートが7c

ps及び変調度が0.65であり、いずれも良好な値を示した。

【0109】 [実施例31~45] 〔表1]、〔表2] および [表4] に記載したアゾ化合物 (1-1~1-3,1-18~1-22,1-39~45) を用いる以外は、実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0110】作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0111】なお、[表1]~[表13] に記載されている他の化合物においても、635nmの波長で記録後、635nmおよび650nmの波長での再生において、良好な記録特性を示すことを確認した。

【0112】 [比較例1] 実施例2において、アゾ化合物 (1-17) の代わりに、ペンタメチンシアニン色素NK -2929 [1,3,3,1',3',3'- ヘキサメチル-2',2'-(4,5,4',5'-ジベンゾ) インドジカルボシアニンパークロレート、日本感光色素研究所製] を用いること以外は同様にして光記録媒体を作製した。作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、先速3.5 m/s、レーザーパワー7 mWで記録した。記録後、650 nm及び635 nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生した結果、反射率は低く、エラーレートは大きく、変調度も小さかった。さらに、長時間再生していると信号が劣化した。

【0113】 [比較例2] 比較例1において、NK2929の代わりにトリメチンシアニン色素NK79 [1,3,3,1',3',3'- ヘキサメチル-2',2'- インドジカルボシアニンアイオダイド、日本感光色素研究所製]を用いたこと以外は同様にして光記録媒体を作製した。作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、先速3.5m/s、レーザーパワー7mWで記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生した結果、波形が歪み、エラーレートは大きく、変調度も小さかった。さらに、長時間再生していると信号が劣化した。

【0114】以上の実験例1~45および比較例1~2において、記録層の光学定数および各媒体を635nmで記録して、650及び635nmでの再生時の反射

 率、エラーレート、変調度を〔表14〕~〔表19〕に
 【0115】

 まとめて示す。
 【表14】

[0116]

実施例	1	2	3	4	5	6	7	8
化学式No	2-49	2-49	2-49	2-49	2-1	2-2	2-3	2-4
吸収極大(nn	540	540	540	540	510	510	520	520
光学定数								
650mm n#1	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2	2.0	1.9	2.1	2. 0
102	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07
635nm n	2.5	2. 5	2. 5	2. 5	2. 3	2.3	2.5	2. 4
ì	0.13	0.13	0.13	0.13	O. 0B	0.09	0.10	0.11
95nm記錄								
650na再生								
反射率(%)	60	61	69	58	59	5 6	57	55
17-V-1 (cps	8	7	5	8	9	10	10	12
変調度	0.70	0.71	0.75	0.65	0.64	0.63	D. 55	0.68
635mm再生								
反射率(%)	58	59	60	5.5	55	5 \$. 56	53
17-V-1 (cps) 6	6	5	8	9	8	9	8
変調度	0.75	0.77	0.80	0.66	0.66	0.64	0.66	0.6

#1 n; 屈折率 #2 k:消衰係数 【表 1 5】

実施例	9	1 0	11.	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
化学式No	2-5	2-6	2-19	2-20	2-21	2-22	2-23	2-24
吸収極大(nm)	530	530	530	530	510	520	520	520
光学定数								
650nm n*1	2.1	2.1	2. 1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0
1+2	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06	0.09	0.11	0.09
635 nm. n	2. 4	2. 5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4
k	0.12	0.13	0.13	0.15	0.10	0.12	0.12	0.11
685nm記録 650nn再生								
	56	55	51	52	51	53	51	53
17-V- (cps)	9	9	10	9	9	10	9	11
変調度	0.65	0.64	0.50	0.63	0.58	0.63	0.62	0.63
6 3 5mm再生								
反射率(%)	54	5 9	60	54	55	54	. 53	55
17-1-1(cps)	8	7	5	10	9	8	9	10
変調度	0.65	0.67	0.62	0.65	0.62	0.65	0.65	0.54

#1 n: 屈折率 #2 k;消資係数

[0117]

【表16】

実施例		1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	22.	2 3	2 4
化学式B	0	2-13	2-34	2-35	2-57	2-58	2-59	2-60	2-61
吸収極大	(nm)	580	520	530	\$50	540	550	555	535
光学定數	ŧ								
650nm	n#1	2.1	2.0	2.1	2. 2	2.0	2.1	2.1	2.0
	k # 2	0.10	0.09	0.11	0.12	0.06	0.11	0.11	0.07
635nm	n	2.4	2.4	2.4	2.6	2. 5	2.5	2. 4	2. 5
	k	0.12	0.11	0.12	0.14	0.10	0.13	0.15	0.10
685nm記録									
650nn再4	Ė								
反射率	(%)	56	57	53	58	59	58	59	60
17-1-1	(cps)	10	11	12	8	9	10	10	11
変割度		0.60	0.58	0.60	0.67	0.68	0.67	0.66	0. 65
635nm再4	ŧ							-	
反射率	(%)	54	55	55	57	58	57	57	57
17-1-1	(cps)	12	11	13	9	8	9	8	8
変調度		0.68	0.62	0.64	0.72	0.70	0.71	0.69	0.69

#1 n; 屈折率 #2 k;消疫係数

[0118]

【表17】

実施例	2 5	2 6	27.	2 8	2 9	3 1	a <u>2</u>	3 3
化学式No	2-62	2-69	2-64	2-85	2-66	1-1	1-2	1-3
吸収極大(nm)	540	545	595	540	550	465	470	460
光学定数								
650nm n+1	2.1	2. 0	2.0	2. 0	2.1	1.9	1.9	1.8
k*2	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.05	0.05	0.04
635nm n	2.4	2. 5	2.4	Z. 4	2.5	2. 1	2.1	2. D
k	0.12	0.18	0.11	0.12	0.13	0.08	0.07	D. 07
35nn記録								
650nm再生 反射率(%)	2.0	59	61	56	50	46	4.5	45
15-1-1(cps)		8	7	8	8		15	14
		0.68			_			0.5
635nm再生								
反射率(%)	56	57	59	5 7	5 9	47	46	46
Ij-b-b(cps)	6	7	5	7	8	14	13	12
変調度	0.70	0.71	0.69	0.68	0.68	0.58	0.58	0.5

[0119]

#1 n; 屈折率 #2 k:消衰係数 【表 1 8】

実施例	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1
化学式No	1-18	1-19	1-20	1-21	1-22	1-89	1-40	1-41
吸収極大(nm)	470	475	465	465	470	480	485	460
光学定数								
650nm n#1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9
k * 2	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07
635nm n	2.1	2.0	2.0	2. 0	2.0	2.1	2.1	2.0
k	0.07	0.08	0.07	0.07	0.01	0.08	0.09	0.08
635nn記録								
650nm再生								
反射率(%)	46	4.5	49	49	49	5 2	51	49
17-1-1(eps)	13	14	15	13	15	12	11	10
変調度	0.51	0.58	0.54	0.54	0.54	0.60	0.64	0.59
635nm再生								
反射率(%)	48	48	50	50	50	53	52	51
19-6-}(cps)	12	14	13	15	14	10	. 10	10
変調度	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.66	0.57	0.64

*1 n; 屈折率 *2 k;消衰係数

[0120]

【表19】

実施例	4 2	4 3	4 4	4 5	比較例	l 	2
化学式No	1-42	1-43	1-44	1-45		NK2929	NK 79
吸収極大(nm)	470	475	465	465		640	550
光学定数							
650nm n#1	1. 8	1.8	1.8	1.8		1.9	2.1
k # 2	0.05	0.06	0.05	0.06		1.35	0.08
635nm n	2. 1	2.0	2.0	2. 0		1.8	2. 3
k	0.07	0.08	0.07	0.07		1. 30	0.10
<u>835nm記録</u> 650nm再生							
反射率(%)	51	49	50	50		9	5.6
Ij-b-⊦(cps)	10	10	9	10		3000	550
変調度	0.68	0.59	0.60	0.62		0.13	0.35
635nm再生							
反射率(%)	54	53	5 3	52		9 .	60
17-V-\(cps)	9	9	9	8		2500	350
変異度	0.67	0.64	0.66	0.66		0.15	0.38

#1 n; 屈折率 #2 k;消衰係数

[0121]

【発明の効果】本発明によれば、特定の骨格のアゾ色素で、適当な吸収波長と光学定数(屈折率と消衰係数)を有するものを記録層とすることにより、波長520~690nmのレーザーでの良好な高密度記録及び再生が可能な追記型光記録媒体を提供できる。

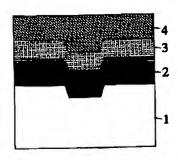
【図面の簡単な説明】

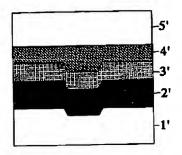
【図1】従来の光記録媒体及び本発明の層構成を示す断面構造図

【図2】本発明の光記録媒体の層構成を示す断面構造図

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 記録層
- 3 反射層
- 4 保護層
- 1' 基板
- 2' 記録層
- 3' 反射層
- 4'接着層
- 5' 基板





フロントページの続き

(72) 発明者 杉本 賢一 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内

(72) 発明者 西本 泰三 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内

(72) 発明者 津田 武 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内

(72) 発明者 広瀬 純夫 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内

BEST AVAILABLE COPY